3/5/1

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2000 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

05512522 \*\*Image available\*\*
DIFFRACTION OPTICAL ELEMENT

PUB. NO.: 09-127322 [JP 9127322 A] PUBLISHED: May 16, 1997 (19970516)

INVENTOR(s): ISHII TETSUYA

APPLICANT(s): OLYMPUS OPTICAL CO LTD [000037] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)
APPL. NO.: 08-138645 [JP 96138645]
FILED: May 31, 1996 (19960531)

INTL CLASS: [6] G02B-005/18

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment)

JAPIO KEYWORD: R044 (CHEMISTRY -- Photosensitive Resins); R125 (CHEMISTRY --

Polycarbonate Resins)

#### **ABSTRACT**

PROBLEM TO BE SOLVED: To effectively prevent a flare, a ghost, etc., from being generated by easily manufacturing the diffraction optical element and reducing the wavelength dependency of its diffraction efficiency.

SOLUTION: This diffraction optical element has 1st, 2nd, and 3rd areas 11, 12, and 13 which are laminated in order very closely or closely, a 1st relief pattern 21 which is formed on the border surface between the 1st and 2nd areas 11 and 12, and a 2nd relief pattern 22 which is formed on the border surface between the 2nd and 3rd areas 12 and 13. Then the 1st, 2nd, and 3rd areas 11, 12, and 13 are formed of mutually different materials which are substantially transparent to the wavelength of light in use and the 1st and 2nd relief patterns 21 and 22 have substantially equal pitch distributions and mutually different groove depths d(sub 1) and d(sub 2) and are so arranged that their corresponding positions are close to each other.

,

```
PN="JP 9
?t 3/3/1
 3/3/1
DIALOG(R) File 345: Inpadoc/Fam. & Legal Stat
(c) 2000 EPO. All rts. reserv.
13736604
Basic Patent (No, Kind, Date): JP 9127322 A2 970516 <No. of Patents: 001>
  DIFFRACTION OPTICAL ELEMENT (English)
Patent Assignee: OLYMPUS OPTICAL CO
```

Author (Inventor): ISHII TETSUYA

IPC: \*G02B-005/18;

Derwent WPI Acc No: \*G 97-323951; G 97-323951

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date JP 9127322 A2 970516 JP 96138645 Α 960531 (BASIC)

Priority Data (No, Kind, Date): JP 96138645 A 960531 JP 95220753 A 950829

?

#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出版公開番号

# 特開平9-127322

(43)公開日 平成9年(1997)5月16日

(51) Int.Cl.<sup>8</sup>

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G02B 5/18

G02B 5/18

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 14 頁)

(21)出願番号

特膜平8-138645

(22)出顧日

平成8年(1996)5月31日

(31) 優先権主張番号 特膜平7-220753

(32) 優先日

平7(1995)8月29日

(33)優先權主張国

日本(JP)

(71)出顧人 000000376

オリンパス光学工業株式会社

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号

(72) 発明者 石井 哲也

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリ

ンパス光学工業株式会社内

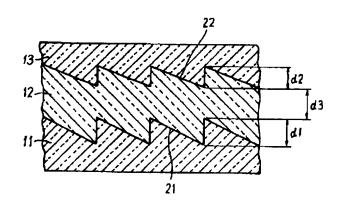
(74)代理人 弁理士 杉村 暁秀 (外4名)

# (54) 【発明の名称】 回折光学素子

#### (57)【要約】

【課題】 容易に製造でき、しかも回折効率の波長依存 を低減して、フレアやゴースト等の発生を有効に防止で きる回折光学素子を提供する。

【解決手段】 密接または近接して順次に積層した第 1、第2および第3の領域(11,12,13)と、第1および第 2の領域(11.12) の境界面に形成した第1のレリーフパ ターン(21)と、第2および第3の領域(12,13) の境界面 に形成した第2のレリーフパターン(22)とを有し、第 1、第2および第3の領域(11,12,13)は、使用する光の 波長で実質的に透明な互いに異なる材料をもって構成さ れ、第1 および第2のレリーフパターン(21,22) は、実 質的に等しいピッチ分布で、互いに異なる溝深さ(d1. d2) を有し、それらの対応する部位が近接して配置され ていることを特徴とする。



.

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 密接または近接して順次に積層した第 1、第2および第3の領域と、

1.

前記第1および第2の領域の境界面に形成した第1のレ リーフパターンと、

前記第2および第3の領域の境界面に形成した第2のレリーフパターンとを有し、

前記第1、第2および第3の領域は、使用する光の波長で実質的に透明な互いに異なる材料をもって構成され、前記第1および第2のレリーフパターンは、実質的に等 10 しいピッチ分布で、互いに異なる溝深さを有し、それらの対応する部位が近接して配置されていることを特徴とする回折光学素子。

【請求項2】 密接または近接して順次に積層した第 1、第2および第3の領域と、

前記第1および第2の領域の境界面に形成した第1のレ リーフパターンと、

前記第2および第3の領域の境界面に形成した第2のレリーフパターンとを有し、

前記第1の領域は、使用する光を反射する材料をもって 20 構成され、

前記第2および第3の領域は、使用する光の波長で実質的に透明な互いに異なる材料をもって構成され、

前記第1および第2のレリーフパターンは、実質的に等しいピッチ分布で、互いに異なる溝深さを有し、それらの対応する部位が近接して配置されていることを特徴とする回折光学素子。

【請求項3】 密接または近接して順次に積層した第 1、第2および第3の領域と、

前記第1および第2の領域の境界面に形成した第1のレ 30 リーフパターンと、

前記第2および第3の領域の境界面に形成した第2のレリーフパターンとを有し、

前記第1、第2および第3の領域は、使用する光の波長で実質的に透明な互いに異なる材料をもって構成され、前記第1および第2のレリーフパターンは、実質的に等しいピッチ分布で、対応する部位が近接して配置され、かつ、前記第1、第2および第3の領域をそれぞれ構成する材料の屈折率を、 $n_1(\lambda)$ 、 $n_2(\lambda)$  および $n_3(\lambda)$  とし、

前記第1 および第2のレリーフパターンのそれぞれの溝深さを、 $d_1$  および  $d_2$  、それらの比を、 $\alpha = d_2/d_1$  として、

【数1】 $\Delta N(\lambda) = \{n_1(\lambda) - n_2(\lambda)\} + \alpha \{n_2(\lambda) - n_3(\lambda)\}$ 

ただし、入:光の波長

とするとき、

#### 【数2】

 $|\Delta N(\lambda_2)|>|\Delta N(\lambda_1)|>0;\lambda_2>\lambda_1$ かだ!  $\lambda$ , ・毎日オス半の油트帰の短油巨農の油目

A2:使用する光の波長域の長波長端の波長 を満たすことを特徴とする回折光学素子。

【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、複数の波長、あるいは帯域光で使用する回折光学素子に関するものである。

2

#### [0002]

【従来の技術】回折光学素子、例えば、レンズ作用を有するように構成した回折光学素子(回折レンズ)は、以下に示すように、従来からある屈折レンズにはない特長を有することが知られている。

**①非球面波を容易に生成することができるので、収差を効果的に補正することができる。** 

②実質的に厚みを持たないので、設計の自由度が高く、 コンパクトな光学系を実現することができる。

③屈折レンズでのアッベ数に相当する量が、回折レンズでは負の値となるので、屈折素子との組み合わせによって、色収差を効果的に補正することができる。

【0003】このような回折レンズの特長を利用し、光学系の性能を向上させることに関しては、例えば、Binary Optics Technology; The Theory and Design of Multi-Level Diffractive Optical Element, Gary J.Swans on, Technical Report 854, MIT Lincoln Laboratory, August 1989. に詳しく記述されている。

【0004】上述したように、回折光学素子には、従来の屈折素子にはない多くの有用な特長があるが、他方では、回折効率が波長に依存するために、以下のような原理的な問題がある。例えば、光学系に適用する回折光学素子は、レンズ素子として利用する場合が多いが、このような用途においては、複数の回折光(複数の焦点)が存在するのは、一般に好ましくない。そこで、従来の回折光学素子(具体的には回折レンズ)においては、一般に、図19に示すように、使用する波長で透明な基材1に、断面を鋸歯波状とした(ブレーズ化した)レリーフパターン2を形成して、特定次数の回折光にエネルギーを集中させるようにしている。

【0005】しかしながら、図19に示すように、断面を鋸歯波状に加工すると、その溝深さによってエネルギーを集中できる波長、すなわち回折効率が最大になる波長が異なるため、波長幅を有する帯域光のエネルギーを特定次数の回折光に集中させることができなくなる。このような現象は、例えば、レーザーのような、単色光を利用する光学系の場合には問題にならないが、カメラのように白色光を利用する光学系では、特定の波長の光で回折効率を最適化すると、その他の波長で回折効率が低下してしまうという問題がある。

【0006】図20は、図19に示した断面形状を有する回折光学素子において、基材1としてBK7を用い、

(3)

次回折効率が100%となるような溝深さで形成した場 合の1次回折効率と波長との関係を示したものである。 図20から明らかなように、一般に可視波長領域と見な せる $\lambda = 400$ nmから $\lambda = 700$ nmにおいて、回折 効率は、最適化した波長入=510 nmから離れるに従 って減少し、特に、短波長領域での低下が著しくなる。 このような回折効率の低下は、単に分光透過率が低下す るといった問題にとどまらず、溝深さが最適化されてい ない波長において、不要次数の回折光が発生することに なる。このため、かかる回折光学素子を、帯域光を用い 10 後、位相振幅と呼ぶことにする)aを用いれば、 る光学系、例えば、白色光で用いる撮像光学系に適用し\*

用いる撮像光学系に適用し\* 【数3】
$$\eta_{n} = \left\{ \begin{array}{c} \sin (m-a) \pi \\ \hline (m-a) \pi \end{array} \right\}^{2}$$

で与えられる。

【0008】(1)式において、位相振幅aは、空気の 屈折率を1、レリーフパターンを形成した基材の屈折率 をn、溝深さをd、および使用する光の波長を入とし て、

$$\mathbf{a} = \frac{(\mathbf{n} - 1) d}{\lambda}$$
(2)
$$\mathbf{n} (\lambda) - 1$$

となる。

【0009】(4)式は、ある定まった溝深さ d』に対 して、位相振幅aが波長に依存することを意味し、この ように、回折効率の波長依存が引き起こされる。例え ば、図20に示した回折効率の波長依存も、このような 現象の結果である。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】本出願人は、上述した ような回折効率の波長依存性の仕組みを詳細に検討し、 回折効率の波長依存性を低減した新しいタイプのレリー フ型回折光学素子を既に提案している′(特願平7-22★ \*た場合には、フレアーやゴーストが生じて、光学系の性 能を低下させることになる。

【0007】ここで、図19に示した断面が鋸歯波状の レリーフパターンは、図21に示すような位相シフト関 数φ(x)で表すことができる。このφ(x)は、レリ ーフパターンの波面変調作用を特長づける関数で、その 形状は、レリーフパターンの断面形状に対応した周期関 数となる。この位相シフト関数φ(x)で表されるレリ ーフパターンのm次回折効率n。は、その振れ幅(以

$$-$$
 (1)

※で定義される量である。ここで、波長入。で、mo次回 折効率が100%となるように最適化した溝深さd o は、

【数5】

【数6】

λο

20

 $n(\lambda_0)-1$ 

$$d_0 = \frac{m_0 \lambda_0}{n (\lambda_0) - 1} \tag{3}$$

となるので、このときの位相振幅aは、

(4)

【0011】ここで、レリーフパターン20の断面形状 を、図22に示すように鋸歯波状として、その溝深さ を、波長Ao でmo 次回折効率が100%となるように 最適化した場合の位相振幅a(A)は、

【数7】

$$a(\lambda) = m_0 \cdot \frac{n_1(\lambda) - n_2(\lambda)}{n_1(\lambda_0) - n_2(\lambda_0)} \cdot \frac{\lambda_0}{\lambda}$$
 (5)

で与えられる。ただし、 $n_1(\lambda)$  は、高屈折率低分散の 光学材料10aの屈折率を示し、n2(λ) は、低屈折率 高分散の光学材料10bの屈折率を示す。

【0012】(5)式において、2種類の光学材料の屈 折率n1, n2が、使用する波長帯域にわたって、例え ば、23に示すように、 $n_1(\lambda) > n_2(\lambda)$  であると すると、分子に現われる屈折率差は波長入の増加に伴っ て増加し、分母の入の変化分を打ち消すようになる。し れおって - 唐和仁師の油目亦ルロ - / 4 / 中が主ゃらて人の

☆場合と比較して小さく抑えられるので、結果として、回 折効率の波長変化を小さく抑えることができる。

【0013】しかしながら、現実に存在する光学材料の 屈折率と分散(屈折率の波長分散)との関係は、おおよ そ、屈折率が大きくなるほど分散も大きくなる傾向を示 すため、十分な効果を有する光学材料の組み合わせを見 い出すのは容易ではない。例えば、可視帯域光で使用す る光学材料には、豊富な種類があるが、基本的には屈折 ボのHillin は、アム型 1 Hillin ホッ

使用する光学材料の多くは、いわゆる光学ガラスである が、2種類の光学材料としてそれぞれ光学ガラスを選ん だ場合には、加工性が悪いことから、その境界面に微細 なレリーフパターンを形成するのは容易ではない。さら に、製造の容易さを考慮して、2種類の光学材料の少な くとも一方を、加工の容易なプラスチック光学材料とす ることもできるが、プラスチック光学材料は種類が少な いため、十分な効果を有する光学材料の組み合わせは大 きく制限される。特に、プラスチック光学材料どうしの 組み合わせでは、回折効率の波長依存性を改善するのは 10 容易ではない。

. 5

【0014】この発明は、上述した問題点に着目してな されたもので、容易に製造でき、しかも回折効率の波長 依存を低減して、フレアやゴースト等の発生を有効に防 止できるよう適切に構成した回折光学素子を提供するこ とを目的とする。

### [0015]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、第1の発明にかかる回折光学素子は、密接または近 接して順次に積層した第1、第2および第3の領域と、 前記第1および第2の領域の境界面に形成した第1のレ リーフパターンと、前記第2および第3の領域の境界面 に形成した第2のレリーフパターンとを有し、前記第 1、第2および第3の領域は、使用する光の波長で実質 的に透明な互いに異なる材料をもって構成され、前記第 1および第2のレリーフパターンは、実質的に等しいピ ッチ分布で、互いに異なる溝深さを有し、それらの対応 する部位が近接して配置されていることを特徴とするも のである。

は、密接または近接して順次に積層した第1、第2およ び第3の領域と、前記第1および第2の領域の境界面に 形成した第1のレリーフパターンと、前記第2および第 3の領域の境界面に形成した第2のレリーフパターンと を有し、前記第1の領域は、使用する光を反射する材料 をもって構成され、前記第2および第3の領域は、使用 する光の波長で実質的に透明な互いに異なる材料をもっ て構成され、前記第1および第2のレリーフパターン は、実質的に等しいピッチ分布で、互いに異なる溝深さ を有し、それらの対応する部位が近接して配置されてい 40 ることを特徴とするものである。

【0017】さらに、第3の発明にかかる回折光学素子 は、密接または近接して順次に積層した第1、第2およ び第3の領域と、前記第1および第2の領域の境界面に 形成した第1のレリーフパターンと、前記第2および第 3の領域の境界面に形成した第2のレリーフパターンと\*

- \*を有し、前記第1、第2および第3の領域は、使用する 光の波長で実質的に透明な互いに異なる材料をもって構 成され、前記第1および第2のレリーフパターンは、実 質的に等しいピッチ分布で、対応する部位が近接して配 置され、かつ、前記第1、第2および第3の領域をそれ ぞれ構成する材料の屈折率を、 $n_1(\lambda)$ 、 $n_2(\lambda)$  およ びn3(A) とし、前記第1および第2のレリーフパター ンのそれぞれの溝深さを、di および dz 、それらの比  $\delta = d_2/d_1$  として、
- 【数8】 $\Delta N(\lambda) = \{n_1(\lambda) n_2(\lambda)\} + \alpha \{n\}$  $_2(\lambda) - n_3(\lambda)$ ただし、入:光の波長 とするとき、

#### 【数9】

 $|\Delta N(\lambda_2)| > |\Delta N(\lambda_1)| > 0; \lambda_2 > \lambda_1$ ただし、入1:使用する光の波長域の短波長端の波長 入2:使用する光の波長域の長波長端の波長 を満たすことを特徴とするものである。

[0018]

【発明の実施の形態】図1は、第1の発明にかかる回折 光学素子の概念図で、断面の一部を模式的に示したもの である。この回折光学素子は、順次に積層した第1の領 域11、第2の領域12および第3の領域13と、第1 の領域11および第2の領域12の境界面に形成した第 1のレリーフパターン21と、第2の領域12および第 3の領域13の境界面に形成した第2のレリーフパター ン22とを有する。第1, 第2および第3の領域11, 12および13は、それぞれ使用する光の波長帯域で実 質的に透明な互いに異なる材料をもって構成する。ここ 【0016】さらに、第2の発明にかかる回折光学素子 30 では、第1の領域11の屈折率をn1(A)、第2の領域 12の屈折率をn2(A)、第3の領域13の屈折率をn **3(λ) とする。** 

> 【0019】また、第1および第2のレリーフパターン 21および22は、等しいピッチ分布を有する断面鋸歯 波状に形成して、対応する部位を対向させる。ここで は、第1のレリーフパターン21の溝深さを di、第2 のレリーフパターン22の溝深さをd2、第1のレリー フパターン21の頂部と第2のレリーフパターン22の 底部との間隔をd3とする。

【0020】図1に示す構成において、回折光学素子に 入射した光は、第1、第2のレリーフパターン21、2 2によってそれぞれ位相変調を受けることになる。この 場合、第1のレリーフパターン21の位相振幅 a1(λ)

【数10】

$$a_1(\lambda) = \frac{\Delta n_1(\lambda)}{\lambda} d_1 : \Delta n_1(\lambda) = n_1(\lambda) - n_2(\lambda)$$
 (6)

【数11】

$$a_{2}(\lambda) = \frac{\Delta n_{2}(\lambda)}{\lambda} d_{1} ; \Delta n_{3}(\lambda) = n_{2}(\lambda) - n_{3}(\lambda)$$
 (7)

となる。

【0021】ここで、第1,第2のレリーフパターン2 1,22よりなる構造を一体と考えて、回折光学素子に\* \*入射した光が実質的に同時に変調されるとすると、その 位相シフト作用を特長づける位相振幅a(入)は、

6構造を一体と考えて、回折光学素子に\* 【数12】 
$$\Delta n_1(\lambda) + \alpha \Delta n_2(\lambda)$$
 a  $(\lambda) = a_1(\lambda) + a_2(\lambda) = \frac{\Delta n_1(\lambda) + \alpha \Delta n_2(\lambda)}{\lambda}$  (8)

のように表すことができる。

【0022】さらに、このときの溝深さを、波長入。に おいてmo 次回折効率が100%となるように最適化す※ ※れば、a(λ<sub>0</sub>) = m<sub>0</sub> なる条件から、 【数13】

$$a (\lambda) = m_0 \frac{\Delta n_1(\lambda) + \alpha \Delta n_2(\lambda)}{\Delta n_1(\lambda_0) + \alpha \Delta n_2(\lambda_0)} \cdot \frac{\lambda_0}{\lambda}$$
 (9)

となる。ただし、 $\alpha$ は、以下のように、第1のレリーフ パターン21の溝深さ  $d_1$  と、第2のレリーフパターン 22の溝深さ  $d_2$  との比で定義される量である。

【数14】

$$a = \frac{d_z}{d_1} \tag{10}$$

【0023】このように、第1の発明にかかる回折光学素子の位相振幅a(λ)は、(8)式で示すように、第1のレリーフパターン21の位相振幅a1(λ)と、第2のレリーフパターン22の位相振幅a2(λ)との和で与えられるが、その波長依存特性は、(10)式で定義したパラメータαに依存している。ここで、パラメータαは、(9)式が示すように、特定波長λ0における回折30効率の最適化とは無関係に、任意に決めることができるパラメータである。

【0024】また、図1に示す構成によれば、第1,第 2および第3の領域11,12および13は、互いに異なる材料で形成されており、屈折率差 $\Delta$   $n_1(\lambda)$  および  $\Delta$   $n_2(\lambda)$  が、異なる波長依存性を示すことになるので、パラメータ $\alpha$ の設定を変えることにより、(9) 式の位相振幅 $\alpha$ ( $\lambda$ ) を、種々の異なった波長依存性を有するようにすることができる。

【0025】したがって、第1の発明によれば、第1,第2のレリーフパターンの溝深さの比、すなわちパラメータ $\alpha$ を最適に設定することにより、特定波長 $\lambda$ 0 における回折効率を最適に保ったまま、それとは独立に回折効率の波長依存だけを好適に制御するたとができる。なお、一般に、二つのレリーフパターンの溝深さを互いに相違させれば、すなわち、 $\alpha \neq 1$ とすれば、回折効率の波長依存を最適に設定することができるが、この発明によれば、第1,第2,第3の領域を構成する材料を適切に組み合わせることにより、 $\alpha = 1$ で、回折効率の波長

★【0026】図2は、第2の発明にかかる回折光学素子の概念図を示すものである。この回折光学素子は、順次に積層した第1の領域14、第2の領域15および第3 の領域16と、第1の領域14および第2の領域15の境界面に形成した第1のレリーフパターン23と、第2の領域15および第3の領域16の境界面に形成した第2のレリーフパターン24とを有する。第1の領域14は、使用する光を反射する材料をもって構成し、第2および第3の領域15および16は、それぞれ使用する光の波長帯域で実質的に透明な互いに異なる材料をもって構成する。

【0027】ここでは、第2の領域15の屈折率をn2(入)とし、第3の領域16の屈折率をn3(入)とする。また、第1,第2のレリーフパターン23.24は、等しいピッチ分布を有し、かつ対応する部位が対向するように、図1の場合と同様に、断面鋸歯波状に形成する。ここでは、図1の場合と同様に、第1のレリーフパターン23の溝深さをd1、第2のレリーフパターン24の溝深さをd2、第1のレリーフパターン23の頂部と、第2のレリーフパターン24の底部との間隔をd3とする。

【0028】図2に示す構成において、第3の領域16 側から回折光学素子に入射した光は、第2,第1のレリーフパターン24,23によってそれぞれ位相変調を受けることになる。ここで、第1のレリーフパターン23は、反射材料で構成された第1の領域14に面しているので、素子に入射した光は、この第1のレリーフパターン23で反射される。したがって、かかる構成の回折光学素子は、全体として反射型回折格子として機能する。【0029】ここで、図1の場合と同様に、第1,第2のレリーフパターン23,24よりなる構造を一体と考え、回折光学素子に入射した光が実質的に同時に変調されるとすると、波長入りにおいてmo次回折効率が10へのシレカストラに、レリーフパターン23,24の溝深

さを設定した場合の位相振幅は、

場合の位相振幅は、 \*\*【数15】
$$-n_2(\lambda) + \alpha \left\{ n_2(\lambda) - n_3(\lambda) \right\} \cdot \frac{\lambda_0}{\lambda}$$

$$-n_2(\lambda_0) + \alpha \left\{ n_2(\lambda_0) - n_3(\lambda_0) \right\} \cdot \frac{\lambda_0}{\lambda}$$
(11)

のように表すことができる。この(11)式は、図1に 示す構成の位相振幅を表す(9)式に相当するもので、 パラメータ $\alpha$ も、第1のレリーフパターン23の溝深さ d1 と、第2のレリーフパターン24の溝深さd2 とに より、(10)式で定義されるものである。

, g

【0030】上記(11)式は、図1に示す構成の位相 振幅を表す(9)式において、光が侵入しない第1の領 域14の屈折率を0とおいたものと一致する。 すなわ ち、図2に示す構成の反射型回折格子の場合も、その位 相振幅は、図1に示す構成の場合と同様に、任意のパラ メータ $\alpha$ を含む形式で表現される。したがって、図2に 示す構成の回折光学素子においても、任意のパラメータ lphaを最適に設定することにより、21に示す構成の回折2 $\Delta N(\lambda) = |\Delta n_1(\lambda) + \alpha \Delta n_2(\lambda)|$ 

としたとき、第3の発明におけるように、 $\Delta N (\lambda)$ が 波長入の増加に伴って増加するように、材料の組み合わ せと、溝深さの比とを最適に設定するのが効果的であ る。

【0032】このようにすれば、(9)式の分子および 分母の波長依存の効果は、互いに相殺し合うので、回折 効率の波長依存をより低減した回折光学素子を実現する ことができる。なお、(9)式は、第1の発明の構成に 対して定義した式であるが、 $n_1(\lambda) = 0$ 、とすること により、(11)式が得られるので、上記(12)式に 関する説明は、第2の発明に対しても同様に成り立つ。

【0033】ところで、実在する光学材料を組み合わせ 30 た場合の屈折率差 $\Delta$ n( $\lambda$ )は、その絶対値が波長 $\lambda$ の 増加に伴って減少する場合が多い。すなわち、所望の特 性とは逆の波長依存性を生じることが多い。これは、実 在する光学材料が、高屈折率高分散から低屈折率低分散 の方向に多く分布しているためである。このような場合 には、上述した第1発明および第2の発明において、2 つの屈折率差の項が互いに打ち消し合うように、溝深さ 比αの代数符号を設定することが、所望の特性とは逆の 波長依存性が打ち消される点で効果的である。これによ り、材料選択の容易さの点で好適な、高屈折率高分散材 料と低屈折率低分散材料とを組み合わせた場合でも、所 望の特性とは逆の波長依存性が打ち消されるので、回折 効率の波長依存性をより低減することができる。

【0034】ここで、溝深さ比αの代数符号の違いは、 レリーフパターンの凹凸の反転に対応する。すなわち、 (10)式で示した $\alpha$ の定義において、 $\alpha$ が正となるの は、図3で示すように、第1、第2のレリーフパターン の山と山(谷と谷)とが対応している場合、つまり、2 つのレリーフパターンの凹凸が対応している場合であ

※光学素子の場合と同様に、特定波長入。における回折効 率を最適に保ったまま、それとは独立に回折効率の波長 依存だけを好適に制御することができる。

【0031】上記第1の発明において、回折効率の波長 依存をより小さくするためには、(8)式、もしくは (9)式で示された位相振幅a(入)の波長依存をより 小さくする必要がある。例えば、(9)式において、位 相振幅a(A)の波長依存を決めるのは、分子にある2 つの屈折率差の項、 $\Delta$   $n_1(\lambda)$  および $\alpha$   $\Delta$   $n_2(\lambda)$  と、 分母にあるんである。したがって、この波長依存をより 小さくするためには、2つの屈折率差の項の和の絶対値  $\Delta N(\lambda) \delta$ 

【数16】

(12)

★うに、第1, 第2のレリーフパターンの山と谷(谷と 山) とが対応している場合、つまり、2つのレリーフパ ターンの凹凸が反転して対応している場合である。

【0035】なお、第1の発明および第2の発明におい て、第3の領域13および16は、該領域の接する環境 の雰囲気とすることもできる。例えば、通常の使用状態 において、環境は空気なので、第3の領域13および1 6を空気で構成することもできる。この場合には、組み 合わせる透明材料との屈折率差を大きくすることができ るので、必要なレリーフパターンの溝深さを浅くするこ とができ、これにより高性能な回折光学素子を実現する ことができる。

【0036】ところで、回折光学素子は、一般に厚型と 薄型とに分類されるが、波長幅を有する帯域光で、特に 結像光学系に適用する場合は、入射角依存や波長依存が 比較的少ない薄型をとすることが好ましい。ここで、回 折光学素子の厚さを特長づけるパラメータとしては、

【数17】  $2 \pi \lambda D$ (13)

で与えられるQ値がよく知られており、一般に、Q<1 のとき、その回折光学素子は薄型に分類される。ただ し、(13)式において、Aは波長、Tは周期構造のピ ッチ、Dは周期構造の深さ、no は周期構造の平均屈折 率である。したがって、この発明に係る回折光学素子に おいても、Q<1を満たすように構成することが好まし 11.

【0037】(13)式から、回折光学素子の厚さを示 すパラメータQは、波長入に依存しているが、使用する 波長範囲全般にわたって回折効率の均一性を維持するた **ムロは 舞り伸田する帯域米の中心波長について、薄型** 

12 \*【0038】さらに、本発明者による検討によれば、Q

<0.1のときのレリーフ格子は、薄型の性質をより良

く表すことが確認された。したがって、この発明に係る

回折光学素子においても、より好適には、Q<0.1と

【0039】ここで、図1に示した構成の回折光学素子

における、周期構造の深さDおよび平均屈折率no は、

なるように、周期構造を構成するのが望ましい。

の条件、Q<1が満たされていればよい。したがって、 この発明に係る回折光学素子においても、使用する帯域 光の中心波長について、Q<1を満たすように構成する のが好ましい。例えば、この発明に係る回折光学素子 を、可視帯域光で使用する光学系に適用する場合には、 該中心波長を概ね480nmから550nmの範囲に設 定することができる。ただし、パラメータQが波長入に 依存していることを考慮し、全波長範囲で薄型の条件、

Q<1を満たすことが望ましいのは言うまでもない。

$$D = d_1 + d_2 + d_3$$

$$d_1 = \frac{n_1 + n_2}{2} + d_2 = \frac{n_2 + n_3}{2} + d_3 n_2$$

$$n_0 = \frac{1}{d_1 + d_2 + d_3}$$
(14)

【数18】

で与えられる。また、図2に示した構成の回折光学素子 ※【数19】 における、周期構造の深さDおよび平均屈折率no は、※

$$D=2 (d_1 + d_2 + d_3)$$

$$d_1 = \frac{n_2}{2} + d_2 = \frac{n_2 + n_3}{2} + d_3 n_2$$

$$n_0 = \frac{1}{d_1 + d_2 + d_3}$$
(16)

で与えられる。

【0040】この発明に係る回折光学素子は、使用する 波長範囲が、所定量以上の幅を有する場合に効果が大き い。ここで、任意の波長入で回折効率を最適化した通常 のレリーフ格子において、回折効率の変化が無視できる 波長変化の幅は、Aの±5%程度が目安であるため、こ の発明に係る回折光学素子は、任意の中心波長入に対し て、その±5%以上の波長幅の帯域光を使用する場合に 効果的である。

【0041】以上、この発明を、第1,第2および第3 の領域が密接した場合を例にとって説明したが、この発 明はこれに限らず、上記の各領域の境界に接着層を設け て、各領域が近接するように構成しても同等の効果を奏 することができる。

【0042】この発明に係る回折光学素子は、複数の波 長、あるいは帯域光で使用する光学装置全般に適用する ことができる。その中でも、特に、結像光学系を有する 光学装置に適用すると効果的である。

【0043】図17は、その一適用例を示すもので、こ の発明に係る回折光学素子を撮像装置、例えば、カメラ の撮影レンズに適用した場合の概念図である。図17に おいて、撮像光学系60は、屈折レンズ51と、この発 明による回折レンズ41とを有し、物体の像を撮像素子 61上に結像するよう構成されている。ここで、この発 明による回折レンズ41は、例えば、可視帯域光の全域 において、高い回折効率を得ることができるので、カラ -- 唖備を掲載した根本のコレアやゴーフトの登上を右姉→ 50

★に防止することができる。

【0044】また、図18は、この発明に係る回折光学 素子の他の適用例を示すもので、観察光学系を含む光学 装置、例えば、カメラのファインダや顕微鏡の接眼レン ズに適用した場合の概念図である。図18において、対 物レンズ53は、物体の拡大実像を形成し、屈折レンズ 52と、この発明による回折レンズ42とを有する接眼 光学系62は、その実像をさらに拡大して観察者の網膜 に投影するよう構成されている。この場合も、図17に 示した撮像装置の場合と同様の効果を得ることができ る。

[0045]

【実施例】図3は、この発明の第1実施例を示すもので ある。この実施例は、透過型の回折レンズを示すもの で、第1の領域101としてオハラ製の光学ガラスLa L14 (nd=1.6968, vd=55.5)を、第 2の領域102として紫外線硬化樹脂(nd=1.5 2, vd=52)を、第3の領域103としてポリカー ポネイト  $(nd=1.58, \nu d=30.5)$  をそれぞ れ用い、これらを順次積層する。また、第1の領域10 1と第2の領域102との境界面、および第2の領域1 02と第3の領域103との境界面には、等しいピッチ 分布を有する第1のレリーフパターン201および第2 のレリーフパターン202を、第1のレリーフパターン 201の頂部と第2のレリーフパターン202の底部と が接するようにそれぞれ形成する。

【ハハイム】 笙1 笙2のレリーフパターンクハ1 ク

02は、所定のレンズ作用を持つように各ピッチ配列を最適化すると共に、各断面を鋸歯波状として、波長 $\lambda=550\,\mathrm{nm}\,\mathrm{cl}\,\mathrm{cm}\,\mathrm{cm}\,\mathrm{dm}\,\mathrm{cm}\,\mathrm{dm}\,\mathrm{cm}\,\mathrm{dm}\,\mathrm{cm}\,\mathrm{dm}\,\mathrm{cm}\,\mathrm{dm}\,\mathrm{cm}\,\mathrm{dm}\,\mathrm{cm}\,\mathrm{dm}\,\mathrm{cm}\,\mathrm{dm}\,\mathrm{cm}\,\mathrm{dm}\,\mathrm{cm}\,\mathrm{cm}\,\mathrm{dm}\,\mathrm{cm}\,\mathrm{$ 

【0047】図4は、この実施例による回折レンズにお いて、(6)式で与えられるΔn1と、(7)式で与え られる△n2 とのそれぞれの波長依存特性を、可視波長 域について示すものである。図4から明らかなように、 LaL14 (第1の領域101)と紫外線硬化樹脂 (第 2の領域102) との屈折率差△n1 は、LaL14の 屈折率のほうが紫外線硬化樹脂の屈折率よりも大きいの で、可視波長帯域で正となり、また、LaL14と紫外 線硬化樹脂とのアッベ数レdが比較的近いことから、波 長入の増加に伴ってわずかに減少する傾向を示す。これ 20 に対して、紫外線硬化樹脂(第2の領域102)とポリ カーボネイト(第3の領域103)との屈折率差An2 は、ポリカーボネイトの屈折率のほうが紫外線硬化樹脂 の屈折率よりも大きいので、可視波長帯域で負となり、 また、波長人の増加に伴って相対的に大きく増加する傾 向を示す。

【0048】この実施例では、図4の $\Delta$ n<sub>1</sub> および $\Delta$ n<sub>2</sub> の波長依存特性から明らかなように、 $\alpha$  $\Delta$ n<sub>2</sub> の絶対値が、 $\Delta$ n<sub>1</sub> の大きさを超えないような正の値の $\alpha$ を選んでいるので、(12)式で定義した屈折率差の項N( $\lambda$ )の波長依存は、波長 $\lambda$ の増加に伴って増加することになる。したがって、(9)式の分母に現れる $\lambda$ は、この屈折率差の項N( $\lambda$ )で良好に相殺され、これにより位相振幅の波長依存が低減され、回折効率の波長依存が低減される。

【0049】図5は、この実施例による回折レンズと従来の回折レンズとの位相振幅の波長依存特性を比較して示すものである。図5において、実線はこの実施例による回折レンズの位相振幅の波長依存特性を示す。また、破線は従来の回折レンズの位相振幅の波長依存特性を示 40したもので、波長λ=510nmで1次回折効率が最大となるように、しaL14の基板にブレーズパターンを形成した場合のものである。図5から明らかなように、αの値を最適化することによって、位相振幅の波長依存が良好に低減されていることがわかる。

【0050】図6は、図5に示した位相振幅の波長依存特性に対応する回折効率の波長依存特性を示すもので、実線および破線は、図5の場合と同じものを表す。図6から明らかなように、この実施例による回折レンズによれば 回折効率の波長依存が従来のよのと比較してきわ 50

めて良好に補正されていることがわかる。

【0051】このように、この実施例による回折レンズによれば、可視帯域光の全域において高い回折効率を得ることができるので、可視帯域光を用いる場合のフレアやゴーストの発生を有効に防止できる。したがって、例えば、カメラのような撮像光学系に好適に適用することができる。

【0052】なお、図5および図6にみられるように、この実施例では、1次回折効率が100%となるように 10 最適化した波長を、従来例とは違えて設定してある。これは、一般に、最適化波長は、使用する波長範囲において回折効率をバランスさせるように設定するからである。つまり、この実施例の場合と従来例の場合とでは、回折効率の波長依存がバランスする最適波長が異なるからである。例えば、図5においては、従来例の最適化波長は510nmであるが、この実施例では550nmである。

【0053】この実施例においては、回折効率の波長依存が、使用する波長帯域の短波長側でより効果的に低減される。したがって、回折効率が最大となるように最適化する波長は、従来の場合と比較してより長波長側に設定することが好ましい。具体的には、使用する波長帯域の中間波長に対し、使用する波長幅の±10%以内の波長範囲に最適化波長を設定するのが望ましい。ここで、使用する波長幅は、例えば、可視帯域光で用いる結像光学系の場合には、400nm~700nmとするのが普通である。

【0054】さらに、この実施例によれば、第2の領域 102を紫外線硬化樹脂をもって構成したので、第1, 30 第2のレリーフパターン201,202を、それぞれ第 1,第3の領域101,103に別々に形成し、その 後、これらを紫外線硬化樹脂を介して貼り合わせるとい う極めて簡単な工程で、回折効率の波長依存性が低減さ れた回折レンズを製造することができる。したがって、 低コストにできるという効果もある。

【0055】なお、かかる効果は、第2の領域102を 紫外線硬化樹脂をもって構成する場合に最も大きいが、 より一般的には、第2の領域102をプラスチック材料 をもって構成することにより、同様の効果を得ることが できる。

【0056】また、第1,第2のレリーフパターン201,202を貼り合わせるにあたっては、第1,第2のレリーフパターン201,202によって発生するモアレ縞を位置合わせに用いることができる。すなわち、モアレ縞が完全に消えるように、第1,第2のレリーフパターン201,202を位置合わせすることにより、それらの対応する部分を対向させることができる。

【0057】図7は、第1実施例の変形例を示すものである。この回折レンズは、外側に面する2つの端面303を正の屋折力を有

する曲面に、他方の端面304を負の屈折力を有する曲 面に形成したもので、その他の構成は第1実施例と同様 である。なお、端面303,304には、それぞれ反射 防止コートを施す。

【0058】かかる回折レンズによれば、回折作用によ るパワーと屈折作用によるパワーとの両方のパワーを有 するので、全体として大きなパワーを持ったレンズ素子 を実現することができる。また、回折作用によるパワー と屈折作用によるパワーとは、波長分散 (アッベ数)が 逆符号であるので、その波長分散の打ち消し合いによ り、色収差が補正されたレンズ素子を実現することがで きる。特に、図7に示すように、外側に面する端面30 3,304の屈折力の符号を反転させることにより、2 次スペクトルまで補正された色消し単レンズを実現する ことができる。

【0059】図8は、この発明の第2実施例を示すもの である。この実施例は、透過型の回折レンズを示すもの で、第1の領域104として旭硝子製のフッ素系樹脂サ イトップ  $(nd=1.34149, \nu d=93.8)$ を、第2の領域105として紫外線硬化樹脂(nd= 1.52, νd=51.8)を、第3の領域106とし てポリカーボネイト(nd=1.58, レd=30. 5)をそれぞれ用い、これらを順次積層する。また、第 1の領域104と第2の領域105との境界面、および 第2の領域105と第3の領域106との境界面には、 等しいピッチ分布を有する第1のレリーフパターン20 3および第2のレリーフパターン204を、第1のレリ ーフパターン203の頂部と第2のレリーフパターン2 04の底部とが接するようにそれぞれ形成する。

04は、所定のレンズ作用を持つように、各ピッチ配列 を最適化すると共に、各断面を鋸歯波状で、凹凸が互い に反転した構造として、波長A=550 nmで1次回折 効率が最大となるように、その溝深さを最適化する。し たがって、第1のレリーフパターン203の溝深さ di と第2のレリーフパターン204の溝深さd2 とは、互 いに逆符号の関係にある。この実施例では、第1のレリ ーフパターン203の溝深さd1を、d1=-9.20 μm、第2のレリーフパターン204の溝深さd2 を、 d2 = 17.84 μmとして、上記(10)式で定義し たパラメータ $\alpha$ を、 $\alpha$  = -1.94とする。また、外側 に面する2つの端面305および306は、ともに平面 として、各端面上に反射防止コートを施す。

【0061】図9は、この実施例による回折レンズにお いて、(6)式で与えられる△n1と(7)式で与えら れる Anz とのそれぞれの波長依存特性を示すものであ る。図9から明らかなように、サイトップ (第1の領域 104)と紫外線硬化樹脂 (第2の領域105)との屈 折率差 Δ n1 、および紫外線硬化樹脂 (第2の領域 1 0 5)とポリカーボネイト (第3の領域106)との屈折 50 率差Δ n2 は、上述した屈折率の大小関係から、ともに 可視波長帯域で負の値をとる。また、これら2つの材料 の組み合わせは、ともに高屈折率高分散-低屈折率低分 散の関係になるので、△ n1 および△ n2 は、ともに波 長の増加に伴って大きさ(絶対値)が減少する。

【0062】この実施例では、αΔn2の大きさ(絶対 値)が、△n:の大きさ(絶対値)を超えないような負 の値のαを選んで設定してあるので、(12)式で定義 した屈折率差の項N(A)の波長依存は、波長Aの増加 10 に伴って増加するようになる。したがって、(9)式の 分母に現れる $\lambda$ は、この屈折率差の項 $N(\lambda)$ で良好に 相殺され、これにより位相振幅の波長依存が低減され、 回折効率の波長依存が低減される。

【0063】図10は、この実施例による回折レンズ と、従来の回折レンズとの回折効率の波長依存特性を比 較して示すものである。図10において、実線はこの実 施例による回折レンズの場合を、破線はサイトップ製の 基板にブレーズパターンを形成した従来の回折レンズ (最適化波長入=510nm)の場合をそれぞれ示して 20 いる。図10から明らかなように、この実施例による回 折レンズによれば、従来のものと比較して回折効率の波 長依存がきわめて良好に補正されていることがわかる。 【0064】このように、この実施例によれば、可視帯 域光の全域において高い回折効率を得ることができるの で、可視帯域光で用いた場合にフレアやゴーストの問題 が生じにくく、したがって、例えばカメラのような撮像 光学系に好適に適用することができる。また、第1、第 3の領域104,106をプラスチック材料をもって構 成したので、第1,第2のレリーフパターン203,2 【0060】第1、第2のレリーフパターン203、2 30 04を極めて容易に形成することができると共に、特 に、第2の領域105を紫外線硬化樹脂をもって構成し ているので、第1,第3の領域104,106に形成し た第1, 第2のレリーフパターン203, 204どうし を容易に貼り合わせることができ、これにより、回折効 率の波長依存が低減された回折光学素子を容易に製造す ることができる。

> 【0065】図11は、この発明の第3実施例を示すも のである。この実施例は、2重焦点の回折レンズを示す もので、順次積層した第1,第2,第3の領域101, 102,103は、第1実施例におけると同じ材料をも って構成する。すなわち、第1の領域101をオハラ製 の光学ガラスLaL14 (nd=1.6968, レd= 55.5)で、第2の領域102を紫外線硬化樹脂(n d=1.52, vd=52)で、第3の領域103をポ リカーボネイト (nd=1.58, νd=30.5) で 構成する。また、第1の領域101と第2の領域102 との境界面、および第2の領域102と第3の領域10 3との境界面には、等しいピッチ分布を有する第1のレ リーフパターン205および第2のレリーフパターン2 りんな 生1 の1.11 つかか いりりゃかになけ

レリーフパターン206の底部とが接するようにそれぞ れ形成する。

【0066】第1, 第2のレリーフパターン205, 2 0.6は、所定のレンズ作用を持つように、各ピッチ配列 を最適化すると共に、各断面を凹凸比の等しい矩形状と して、波長A=600nmで±1次回折効率が最大とな るように、その溝深さを最適化する。この実施例では、 第1のレリーフパターン205の溝深さ dı を、dı= \* \*4.02μm、第2のレリーフパターン206の溝深さ dz を、 $dz = 7.03 \mu m として、上記(10) 式で$ 定義したパラメータαを、α=1.75とする。また、 外側に面する2つの端面307および308は、ともに 平面として、各端面上に反射防止コートを施す。

【0067】この実施例において、±1次回折効率が最 大となるときの、上記(9)式に相当する位相振幅は、

【数20】

$$a(\lambda) = \frac{m_0}{2} \cdot \frac{\{n_1(\lambda) - n_2(\lambda)\} + \alpha \{n_2(\lambda) - n_3(\lambda)\}}{\{n_1(\lambda_0) - n_1(\lambda_0)\} + \alpha \{n_2(\lambda_0) - n_3(\lambda_0)\}} \cdot \frac{\lambda_0}{\lambda}$$
 (18)

で表され、そのときのm次回折効率プロは、  $\eta_{m} = \left\{ \frac{\sin (m\pi/2)}{m\pi/2} \cdot \cos \pi \left(a + \frac{m}{2}\right) \right\}^{2}$ (19)

で与えられる。上記(18)式で表される位相振幅は、 (9)式で表される位相振幅に、係数1/2が掛かった だけであるので、第1実施例の場合と全く同じ作用で、 位相振幅の波長依存を低減することができる。

±1次回折効率の波長依存特性を示すもので、(18) 式を (19) 式に適用した結果を示すものである。図1 2において、実線はこの実施例による回折レンズの場合 を、破線はLaL14の材料基板に矩形位相格子を形成 した従来の回折レンズ (最適化波長入=510nm)の 場合を示す。図12から明らかなように、この実施例に よれば、従来のものと比較して回折効率の波長依存が良 好に補正されていることがわかる。このように、この実 施例によれば、可視帯域光の全域において、回折効率の 波長依存を低減できるので、可視帯域光で使用する2重 30 焦点光学系に好適に適用することができる。

【0069】以上、第1~3実施例において、第1,第 2のレリーフパターンが断面鋸歯波状の場合と、断面矩 形の場合とについて説明したが、第1, 第2のレリーフ バターンの断面形状は、上記の例に限らず、種々の断面 形状の場合でも、この発明を有効に適用することがで き、同様の効果を得ることができる。

【0070】図13は、この発明の第4実施例を示すも のである。この実施例は、透過型の回折レンズを示すも ので、第1の領域107としてアクリル樹脂(nd= 1.49, νd=57.7) を、第2の領域108とし てポリカーボネイト (nd=1.58,  $\nu$ d=30. 5)をそれぞれ用い、これらを順次積層する。また、第 3の領域は、該回折レンズが置かれる雰囲気、実用上は 空気とする。第1の領域107と第2の領域108との 境界面、および第2の領域108と空気との境界面に は、等しいピッチ分布を有する第1のレリーフパターン 207、および第2のレリーフパターン208を、第1 のレリーフパターン207の頂部と第2のレリーフパタ

★【0071】第1, 第2のレリーフパターン207, 2 08は、集光作用を持つように、各ピッチ配列を最適化 すると共に、各断面を鋸歯波状として、波長入=550 nmで1次回折効率が最大となるように、その溝深さを 【0068】図12は、この実施例による回折レンズの20最適化する。この実施例では、第1のレリーフパターン 207の溝深さdi を、di =15.16μm、第2の レリーフパターン208の溝深さd2 を、d2 = 3 . 3  $4\mu$ mとして、上記(10)式で定義したパラメータ $\alpha$ を、α≒0、22とする。

> 【0072】この実施例では、第3の領域を、この回折 レンズが置かれる雰囲気、実用上は空気として、その屈 折率を1としているので、上述した実施例の場合と同様 の作用により、回折効率の波長依存を補正することがで きる。さらに、この実施例では、第3の領域の屈折率が 低いので、第2の領域108と第3の領域との屈折率差 Δη2 が十分大きな値となり、第2のレリーフパターン 208の溝深さd2 を比較的浅くすることができる。こ れにより、回折レンズをより薄型にできるので、レリー フパターンのピッチをより小さくすることができる。

> 【0073】図14は、この実施例による回折レンズ と、従来の回折レンズとの回折効率の波長依存特性を比 較して示すものである。図14において、実線はこの実 施例による回折レンズの場合を、破線はアクリル基板に ブレーズパターンを形成した従来の回折レンズ(最適化 波長入=510nm)の場合を示している。図14から 明らかなように、この実施例の場合も、従来のものと比 較して回折効率の波長依存を極めて良好に補正できるこ とがわかる。

【0074】図15は、この発明の第5実施例を示すも のである。この実施例は、反射型の回折格子を示すもの で、第1の領域111として金属アルミ(Λ1)を、第 2の領域112としてポリカーボネイト(nd=1.5 8. νd=30.5)を、第3の領域113としてアク リル樹脂 (nd=1.49, vd=57.7) をそれぞ お田い これたを順次諸国する すか 第1の領域11

1と第2の領域112との境界面、および第2の領域1 12と第3の領域113との境界面には、等しいピッチ 分布を有する第1のレリーフパターン211および第2 のレリーフパターン212を、第1のレリーフパターン 211の頂部と第2のレリーフパターン212の底部と が互いの領域に食い込むように、すなわち第1,第2の レリーフパターン211,212の間隔d3 が負の値と なるようにそれぞれ形成する。

【0075】第1,第2のレリーフパターン211,2 12は、各ピッチを一定とすると共に、各断面を鋸歯波 10 状として、波長入=550nmにおける1次回折効率が 最大となるようにその溝深さを最適化する。この実施例 では、第1のレリーフパターン211の溝深さは、を、  $d_1 = 0.53 \mu m$ 、第2のレリーフパターン212の 溝深さ $d_2$  を、 $d_2$  = 6.04 $\mu$ mとして、上記(1 0) 式で定義したパラメータαを、α≒11.40とす る。

【0076】この回折格子においては、第1の領域11 1が金属アルミよりなる反射材料で構成されているの で、入射面311から入射した光は、第1のレリーフパ 20 あることを特徴とする回折光学素子。 ターン211で反射される。したがって、かかる回折格 子は、反射型回折格子として機能する。また、この回折 格子における回折効率の波長依存については、上述した (11)式で説明することができる。すなわち、(1 1)式は、ここまで説明してきた透過型回折レンズの位 相振幅を表す(9)式において、第1の領域の屈折率を ゼロとおいた特別な場合とみなせるので、この実施例の 作用も本質的には上述した透過型回折レンズの作用と同 じである。

【0077】この実施例によれば、aを最適に設定する ことにより、第2の領域112を構成するポリカーボネ イトの屈折率の波長依存を、該ポリカーボネイトと第3 の領域113を構成するアクリル樹脂との屈折率差の波 長依存により好適に補正することができる。これによ り、(11)式で示された位相振幅の波長依存が低減さ れ、さらに、回折効率の波長依存が低減される。

【0078】図16は、この実施例による反射型回折格 子と、従来の反射型回折格子との回折効率の波長依存特 性を比較して示すものである。図16において、実線は この実施例による反射型回折格子の場合を、破線は従来 40 の反射型ブレーズ格子(最適化波長λ=510nm)の 場合を示している。図16から明らかなように、この実 施例の場合も、従来のものと比較して回折効率の波長依 存を極めて良好に補正できることがわかる。

#### 【0079】付記項

1. 請求項1記載の回折光学素子において、前記第1、 第2および第3の領域をそれぞれ構成する材料の屈折率 を、n<sub>1</sub>(λ) 、n<sub>2</sub>(λ) およびn<sub>3</sub>(λ) とし、前記第1 および第2のレリーフパターンのそれぞれの溝深さを、  $d_1$  および $d_2$  、それらの比を、 $\alpha = d_2/d_1$  として

【数22】 $\Delta N(\lambda) = \{n_1(\lambda) - n_2(\lambda)\} + \alpha$  $\{n_2(\lambda) - n_3(\lambda)\}$ ただし、入:光の波長 とするとき、

### 【数23】

 $|\Delta N(\lambda_2)| > |\Delta N(\lambda_1)| > 0; \lambda_2 > \lambda_1$ ただし、入1:使用する光の波長域の短波長端の波長 λ2 : 使用する光の波長域の長波長端の波長 を満たすことを特徴とする回折光学素子。

- 2. 請求項1, 2または3記載の回折光学素子におい て、前記第1のレリーフパターンの位相シフト作用、お よび第2のレリーフパターンの位相シフト作用が、代数 的に打ち消し合うように、前記第1のレリーフパターン および第2のレリーフパターンの溝深さ比 $\alpha$ を設定した ことを特徴とする回折光学素子。ただし、 $\alpha = d_2 / d$ ı; dı, d2 は、それぞれ第1,第2のレリーフパタ ーンの溝深さである。
- 3. 請求項1,2または3記載の回折光学素子におい て、前記第3の領域は、該領域の接する環境の雰囲気で
- 4. 請求項1, 2または3記載の回折光学素子におい て、前記第1のレリーフパターンおよび第2のレリーフ パターンで構成された複合レリーフ構造領域の平均屈折 率をne、厚さをD、およびレリーフパターンの最小ピ ッチをTとするとき、

#### 【数24】

$$\frac{2 \pi \lambda_0 D}{n_0 T^2} < 1$$

- を満たすことを特徴とする回折光学素子。ただし、入の は、使用する帯域光の中心波長である。
  - 5. 請求項1,2または3記載の回折光学素子におい て、使用する帯域光の短波長端の波長入1 、長波長端の 波長入2が、

【数25】 \(\lambda\_2 - \lambda\_1 > 0.05 \(\lambda\_0\) を満たすことを特徴とする回折光学素子。ただし、入の は、

【数26】

$$\lambda_0 = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2}$$

で定義した、入1 と入2 との中間波長である。 6. 請求項1~3、付記項1~5のいずれか一つに記載 の回折光学素子を有する光学装置。

# [0080]

【発明の効果】この発明によれば、第1、第2の2つの レリーフパターンの溝深さの比を制御することにより、 すなわち2つのレリーフパターンの薄深さの比を最適に 違えて設定することにより、基板材料等の光学特性とは 50 独立に 位知塩配の油を光を火をはかって、

